

參訪前計畫書

組員:

4A3L0006 張志豪

4A3L0076 邵冠銘

4A3L0093 林子恆

4A3L0072 張佳憲

Q1:參訪動機是什麼？

張志豪：

我想從這次的參訪中，了解各項機台它們的運作，如顯影，蝕刻等等，畢竟自己本身對晶圓的製造與清洗過程有許些的興趣。

邵冠銘：

使自己更瞭解半導體的生產，參觀一般在學校課本上會出現的實物，以便自己更清楚知道自己科系相關產業的東西。

林子恆：

難得有這個機會到業界的公司去參觀，希望可以了解到我們之前學校教得一些理論，實際的應用後與理論之間的差別，像是蝕刻、CVD 等等，以及我們學校的無塵室跟業界中的無塵室的差異。

張佳憲：

希望可以更加瞭解薄膜製成相關的技術以及現在薄膜製程的技術已達到哪個階段。

Q2：自己想要「主動學習」到什麼？

張志豪：

學習些蝕刻、顯影技術，理解每個機台的運作及使用維護，畢竟未來也可能投入這些相關行業，因此對於有這次的參訪機會感到開心，希望從中學習到自己所想知道的知識。

邵冠銘：

濕蝕刻與乾蝕刻差別及作法；熟悉機台操作，減少人為失誤及如何做才能使良率提升。

林子恆：

希望可以學到一些機器儀器是使用在哪一個地方，他們又是怎麼運作的，及使用的操作上又是如何去操作，在製程當中又要注意哪些細節才不會造成錯誤，若是造成了錯誤又該如何去補救、解決問題。

張佳憲：

自己想要學習到什麼？當然還是最希望可以學習到各種機台的操作以及製成時各個步驟會產生哪些影響，還有在製成時容易產生問題的一些小細節。

Q3:預計在參訪時「提問」些什麼問題？

張志豪：

什麼是熱退火製程技術？

真空離子鍍膜技術與傳統鍍膜差別在哪？

半導體製程中的哪一個製程需要用到爐管？

邵冠銘：

既然有那麼多的器具為什麼不做自動化的一條龍生產，不但能減少人力，還可以使人為的錯誤率降低。

林子恆：

微影製程中有哪些細節須要注意的，以及一道完整的製程所需的時間是多少，最重要的步驟又是哪一個？

乾蝕刻與濕蝕刻的差異？

熱退火製程有哪些細節須要注意？

張佳憲：

乾蝕刻與濕蝕刻在製程方面的差別以及在生產方面在成品上如何判斷優劣。